Organization TC2800 Bldg./RoomJeff

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450

ALEXANDRIA, VA 22313-1450

IF UNDELIVERABLE RETURN IN TEN DAYS

OFFICIAL BUSINESS



AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

THW

JAN 2 9 2007 W

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE

01/22/2007

HARNESS, DICKEY, & PIERCE, P.L.C 7700 BONHOMME, STE 400 ST. LOUIS, MO 63105

·	
EXA	AMINER
VELEZ	z, roberto
ART UNIT	PAPER NUMBER
2829	

DATE MAILED: 01/22/2007

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR		ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
10/542,873	07/20/2005	,	Beng Ghee Tan	5731-000014/US/NP	8349

TITLE OF INVENTION: METHOD FOR DETECTING AND MONITORING WAFER PROBING PROCESS INSTABILITY

APPLN, TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	NO	\$1400	\$300	\$0	\$1700	04/23/2007

THE APPLICATION IDENTIFIED ABOVE HAS BEEN EXAMINED AND IS ALLOWED FOR ISSUANCE AS A PATENT. PROSECUTION ON THE MERITS IS CLOSED. THIS NOTICE OF ALLOWANCE IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. THIS APPLICATION IS SUBJECT TO WITHDRAWAL FROM ISSUE AT THE INITIATIVE OF THE OFFICE OR UPON PETITION BY THE APPLICANT. SEE 37 CFR 1.313 AND MPEP 1308.

THE ISSUE FEE AND PUBLICATION FEE (IF REQUIRED) MUST BE PAID WITHIN THREE MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS NOTICE OR THIS APPLICATION SHALL BE REGARDED AS ABANDONED. THIS STATUTORY PERIOD CANNOT BE EXTENDED. SEE 35 U.S.C. 151. THE ISSUE FEE DUE INDICATED ABOVE DOES NOT REFLECT A CREDIT FOR ANY PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE IN THIS APPLICATION. IF AN ISSUE FEE HAS PREVIOUSLY BEEN PAID IN THIS APPLICATION (AS SHOWN ABOVE), THE RETURN OF PART B OF THIS FORM WILL BE CONSIDERED A REQUEST TO REAPPLY THE PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE TOWARD THE ISSUE FEE NOW DUE.

HOW TO REPLY TO THIS NOTICE:

I. Review the SMALL ENTITY status shown above.

If the SMALL ENTITY is shown as YES, verify your current SMALL ENTITY status:

- A. If the status is the same, pay the TOTAL FEE(S) DUE shown above.
- B. If the status above is to be removed, check box 5b on Part B Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and twice the amount of the ISSUE FEE shown above, or

If the SMALL ENTITY is shown as NO:

- A. Pay TOTAL FEE(S) DUE shown above, or
- B. If applicant claimed SMALL ENTITY status before, or is now claiming SMALL ENTITY status, check box 5a on Part B Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and 1/2 the ISSUE FEE shown above.
- II. PART B FEE(S) TRANSMITTAL, or its equivalent, must be completed and returned to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) with your ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). If you are charging the fee(s) to your deposit account, section "4b" of Part B Fee(s) Transmittal should be completed and an extra copy of the form should be submitted. If an equivalent of Part B is filed, a request to reapply a previously paid issue fee must be clearly made, and delays in processing may occur due to the difficulty in recognizing the paper as an equivalent of Part B.
- III. All communications regarding this application must give the application number. Please direct all communications prior to issuance to Mail Stop ISSUE FEE unless advised to the contrary.

IMPORTANT REMINDER: Utility patents issuing on applications filed on or after Dec. 12, 1980 may require payment of maintenance fees. It is patentee's responsibility to ensure timely payment of maintenance fees when due.

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

Complete and send this form, together with applicable fee(s), to: Mail Mail Stop ISSUE FEE

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

or Fax (571)-273-2885

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FFF and PUBLICATION FFF (if required) Blocks 1 through 5 should be complete

CURRENT CORRESPOND	ENCE ADDRESS (Note: Use B	lock 1 for any change of address)	Fee	(s) Transmittal. This	certificate cannot be used	or domestic mailings of the for any other accompanying ent or formal drawing, mus
28997	7590 01/22	2/2007	nav			
HARNESS, D 7700 BONHOM ST. LOUIS, MC		CE, P.L.C	I he Stat addı tran	reby certify that this es Postal Service wit ressed to the Mail s smitted to the USPTO	ficate of Mailing or Tran. Fee(s) Transmittal is bein th sufficient postage for fin Stop ISSUE FEE address O (571) 273-2885, on the	silission g deposited with the United st class mail in an envelope above, or being facsimile late indicated below.
						(Depositor's name)
						(Signature)
						(Date)
APPLICATION NO.	FILING DATE		FIRST NAMED INVENTOR	A	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
10/542,873	07/20/2005		Beng Ghee Tan		5731-000014/US/NP	8349
			RING WAFER PROBING			,
APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE I		
nonprovisional	NO	\$1400	\$300	\$0	\$1700	. 04/23/2007
EXAM	INER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS			
VELEZ, R		2829	324-758000			_
Address form P10/St "Fee Address" ind PT0/SB/47; Rev 03-0 Number is required. 3. ASSIGNEE NAME A	ication (or "Fee Address' 12 or more recent) attach ND RESIDENCE DATA ess an assignee is identi h in 37 CFR 3.11. Comp	'Indication form ed. Use of a Customer A TO BE PRINTED ON	(1) the names of up to or agents OR, alternativ (2) the name of a single registered attorney or a 2 registered patent attool listed, no name will be THE PATENT (print or type data will appear on the patent attool (B) RESIDENCE: (CITY)	vely, e firm (having as a m gent) and the names meys or agents. If no printed. e) atent. If an assignee assignment.	nember a 2	ocument has been filed for
Please check the appropriate. 4a. The following fee(s) a lissue Fee	are submitted:	41:	inted on the patent): D. Payment of Fee(s): (Plea A check is enclosed.	Individual Corp	poration or other private gr	oup entity Government
Advance Order - #	o small entity discount p of Copies	ermitted)	Payment by credit care The Director is hereby		s attached. e the required fee(s), any de	eficiency, or credit any
			overpayment, to Depos	sit Account Number	(enclose a	n extra copy of this form).
 Change in Entity Stat a. Applicant claims 	tus (from status indicated s SMALL ENTITY statu		☐ b. Applicant is no long	er claiming SMALL	ENTITY status. See 37 C	FR 1.27(g)(2).
NOTE: The Issue Fee and interest as shown by the r	d Publication Fee (if requeecords of the United State	aired) will not be accepted tes Patent and Trademark	from anyone other than th			ne assignee or other party in
Authorized Signature				Date		
Typed or printed name				Registration No.		
This collection of informa an application. Confident submitting the completed this form and/or suggestic Box 1450, Alexandria, V Alexandria, Virginia 223	ation is required by 37 Cliality is governed by 35 application form to the ons for reducing this buringinia 22313-1450. DO	FR 1.311. The information U.S.C. 122 and 37 CFR USPTO. Time will vary den, should be sent to the NOT SEND FEES OR C	n is required to obtain or re 1.14. This collection is esti depending upon the indivi chief Information Office COMPLETED FORMS TO	etain a benefit by the mated to take 12 min dual case. Any common, U.S. Patent and Tr THIS ADDRESS.	public which is to file (and nutes to complete, includir ments on the amount of the ademark Office, U.S. Dep. SEND TO: Commissioner	by the USPTO to process) g gathering, preparing, and me you require to complete artment of Commerce, P.O. for Patents, P.O. Box 1450,

PTOL-85 (Rev. 07/06) Approved for use through 04/30/2007.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO. CONFIRMATION	
10/542,873 07/20/2005		Beng Ghee Tan	5731-000014/US/NP	8349
28997 75	90 · 01/22/2007	EXAMINER		
HARNESS, DIC	KEY, & PIERCE, P.	VELEZ, R	OBERTO	
7700 BONHOMM	•		ART UNIT	PAPER NUMBER
ST. LOUIS, MO 63	3105	2829 DATE MAILED: 01/22/2007	7	

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b)

(application filed on or after May 29, 2000)

The Patent Term Adjustment to date is 15 day(s). If the issue fee is paid on the date that is three months after the mailing date of this notice and the patent issues on the Tuesday before the date that is 28 weeks (six and a half months) after the mailing date of this notice, the Patent Term Adjustment will be 15 day(s).

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA.

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information Retrieval (PAIR) WEB site (http://pair.uspto.gov).

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571)-272-4200.

	Application No.	Applicant(s)			
		TAN, BENG GHEE			
Notice of Allowability	10/542,873 Examiner	Art Unit			
•					
	Roberto Velez	2829			
The MAILING DATE of this communication apper All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RI of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313	(OR REMAINS) CLOSED in this app or other appropriate communication GHTS. This application is subject to	olication. If not included will be mailed in due course. THIS			
1. This communication is responsive to <u>12/15/2006</u> .					
2. The allowed claim(s) is/are 1-18.					
 Acknowledgment is made of a claim for foreign priority ur a) ☐ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the: 					
Certified copies of the priority documents have					
2. Certified copies of the priority documents have					
3. Copies of the certified copies of the priority do	cuments have been received in this	national stage application from the			
International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).	•				
* Certified copies not received:					
Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application. THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.					
4. A SUBSTITUTE OATH OR DECLARATION must be subminformal PATENT APPLICATION (PTO-152) which give	itted. Note the attached EXAMINER es reason(s) why the oath or declara	'S AMENDMENT or NOTICE OF ation is deficient.			
5. CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.					
(a) ☐ including changes required by the Notice of Draftspers		-948) attached			
1) hereto or 2) to Paper No./Mail Date					
(b) including changes required by the attached Examiner Paper No./Mail Date	s Amendment / Comment or in the C	Office action of			
Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1 each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the same of	1.84(c)) should be written on the drawi the header according to 37 CFR 1.121(ngs in the front (not the back) of (d).			
6. DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the depo attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT	sit of BIOLOGICAL MATERIAL FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGIC	must be submitted. Note the CAL MATERIAL.			
	,				
Attachment(s)	5. Notice of Informal I	Patent Application			
1. Notice of References Cited (PTO-892)	6. Interview Summary				
2. Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948)	Paner No /Mail Da	ate .			
3. Information Disclosure Statements (PTO/SB/08),	7. 🛛 Examiner's Amend	Iment/Comment			
Paper No./Mail Date 4. Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit of Biological Material	8. X Examiner's Statem	ent of Reasons for Allowance			
	9. Other				
·		Roberto Velez Patent Examiner			

Art Unit: 2829

DETAILED ACTION

EXAMINER'S AMENDMENT

1. An examiner's amendment to the record appears below. Should the changes and/or additions be unacceptable to applicant, an amendment may be filed as provided by 37 CFR 1.312. To ensure consideration of such an amendment, it MUST be submitted no later than the payment of the issue fee.

Authorization for this examiner's amendment was given in a telephone interview with Matthew Cutler on 01/16/2007.

2. The application has been amended as follows:

Claim 1. (Currently amended) A method for detecting and monitoring wafer probe stability including the steps of: probing each die on a wafer; for each die determining whether the result of the probe is a pass or a fail; if the result of a probe is a fail, re-probing the die and determining whether the re-probe is a pass or a fail; once all the dies have been probed determining the rate of die re-probes that lead to passes; comparing the rate of passes on re-probes to a predetermined limit; if the rate of passes on re-probes is greater than the predetermined limit, assigning the probe status as unstable; and reporting the unstable probe status to another device.

Art Unit: 2829

Allowable Subject Matter

3. Claims 1-18 are allowed.

4. Claim 18 has been renumbered as claim 5, and claims 5-17 are renumbered 6-18, respectively.

The following is a statement of reasons for allowance: the prior art of record, taken alone or in combination, fails to disclose or render obvious, a method and apparatus for detecting and monitoring wafer probe stability including the steps of: if the result of a probe is a fail, re-probing the die and determining whether the re-probe is a pass or a fail; once all the dies have been probed determining the rate of die re-probes that lead to passes; comparing the rate of passes on re-probes to a pre-determined limit; and if the rate of passes on re-probes is greater than the predetermined limit, assigning the probe status as unstable; and reporting the unstable probe status to another device, as further defined at claims 1 and 17.

Claims 2-16 and 18 depending from claim 1 are allowed for the same reason.

5. The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to applicant's disclosure.

Tsai (US Pat. 6,281,694) discloses a monitor method for testing probe pins.

Carney (US Pat. 6,043,668) discloses a planarity verification system for integrated circuit test probes.

Art Unit: 2829

Sigler (US Pat. 5,065,092) discloses a system for locating probe tips on an integrated circuit probe card and method therefor.

Ohmart et al. (US Pat. 5,589,765) discloses a method for final testing of semiconductor devices.

Khoury et al. (US Pat. 6,127,831) discloses a method of testing a semiconductor device by automatically measuring probe tip parameters.

Tsuchiya et al. (JP05072245A) discloses a device for discriminating probe contact state.

Conclusion

6. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Roberto Velez whose telephone number is 571-272-8597. The examiner can normally be reached on Monday-Friday 8:00am-4:30 pm.

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Nguyen Ha can be reached on 571-272-1678. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see http://pair-

Art Unit: 2829

direct.uspto.gov. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

Roberto Velez Patent Examiner (30, 1)

HA TRAN NGUYEN SUPERVISORY PATENT EXAMINER

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	Α	US-6,281,694	08-2001	Tsai, Meng-Jin	324/758
*	В	US-6,043,668	03-2000	Carney, Eric Lane	324/758
*	С	US-5,065,092	11-1991	Sigler, Michael R.	324/758
*	D	US-5,589,765	12-1996	Ohmart et al.	324/158.1
*	Ε	US-6,127,831	10-2000	Khoury et al.	324/754
	F	US-			
	G	US-			
	н	US-			
	ı	US-			
	J	US-			
	К	US-			
	L	US-			
	М	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N	JP 05072245 A	03-1993	Japan	TSUCHIYA et al.	
	0					
	Р					
	Q					
	R					
	s					
	Т	<u> </u>				

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	υ	
	٧	
	w	
	x	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-72245

(43)公開日 平成5年(1993)3月23日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G01R 31/00

7808-2G

1/073

D 9016-2G

H01L 21/66

B 7013-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平3-234629

(22)出願日

平成3年(1991)9月13日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 土屋 みどり

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 沢田 正

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 松田 正昭

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 石川 泰男

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プローブ接触状態判別装置

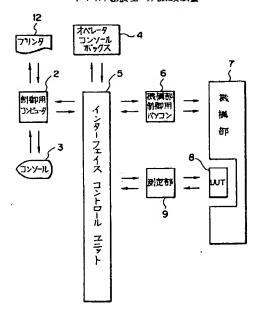
(57)【要約】

【目的】 プリント基板ユニット試験装置のプローブの 試験用ピンの接触状態を判別するプローブ接触状態判別 装置に関し、接触不良の判断基準の統一し、試験装置と プリント基板ユニットとの接触不良を早期に検出し試験 工程の迅速化並びに試験品質の向上を図る。

【構成】 複数の試験用ピンを有するプローブの被試験 対象物(8)に対する接触状態を判別するプローブ接触 状態判別装置において、被試験対象物(8)の試験時の 測定データを記憶する記憶手段(2)と、前記測定デー 夕を読出し、前記の試験の結果の良否を判別し、前記試 験用ピンに対応付けて良否判別データを出力する不良判 別手段(2)と、前記試験用ピン毎に複数の前記良否判 別データを記憶する良否判別データ記憶手段(2)と、 前記記憶された複数の良否判別データに基づき、当該試 験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別する接 触不良判別手段(2)と、を備えて構成する。

プリント基板ユニット 試験装置の基本構成プロック図

1:プリント基板ユニット試験教園



1/16/2007, EAST Version: 2.1.0.14

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の試験用ピンを有するプローブの被 試験対象物に対する接触状態を判別するプローブ接触状 態判別装置において、

前記被試験対象物の試験時の測定データを記憶する記憶 手段と、

前記記憶された測定データを読出して、前記被試験対象 物の試験結果の良否を判別し、前記試験用ピンに対応付 けて良否判別データを出力する不良判別手段と、

る良否判別データ記憶手段と、

前記記憶された複数の良否判別データに基づいて、当該 試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別する 接触不良判別手段と、を備えたことを特徴とするプロー ブ接触状態判別装置。

【請求項2】 請求項1記載のプローブ接触状態判別装 置において、

前記接触不良判別手段は、前記複数の良否判別データの 総数に占める、不良を表す良否判別データの割合により 当該試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別 20 することを特徴とするプローブ接触状態判別装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載のプローブ 接触状態判別装置において、

前記接触不良判別手段は、前記測定データと基準値を比 較し、前記測定データが基準値よりも大きな値を有する 場合に、当該被試験対象物を不良と判別することを特徴 とするプローブ接触状態判別装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プローブの試験用ピン 30 が正常に被試験対象物に接触しているか否かを判別する プローブ接触状態判別装置にかかり、特にプリント基板 ユニット試験装置のプローブの試験用ピンの接触状態を 判別するプローブ接触状態判別装置に関する。

【0002】近年のコンピュータシステムの高速化、高 機能化に伴い、コンピュータシステム内に実装されてい るプリント基板ユニットも複雑化、高密度化している。 また、プリント基板ユニットの試験も高速化が要求され ている。このため、プリント基板ユニット試験装置にお いては、被試験プリント基板ユニットとの試験用接触部 40 に多ピンプローブが用いられている。この多ピンプロー ブは接触不良が起こりやすいため、接触不良を早期に発 見し、プリント基板ユニットの試験を高速化することが 可能なプローブ接触状態判別装置が要望されている。

[0003]

【従来の技術】従来のプリント基板ユニット試験装置に おいては、例えば、図5に示すように、1辺17mmの スペースに460本の試験用ピンを有し、これらが同時 接触するようにしてプリント基板ユニットの試験を行っ ていた。プリント基板ユニットの試験は、被試験プリン 50 物の試験結果の良否を判別し、前記試験用ピンに対応付

ト基板ユニットを複数のモジュールの組み合わせとして とらえ、各モジュール毎にプローブを接触させてデータ を収集することにより行われる。すなわち、一のプリン ト基板ユニットが、144個のモジュールからなってい るとすると、得られるデータ数は、

 $460 \times 144 = 66240 (\vec{r} - 9)$

となる。この場合において、プローブの試験用ピンの接 触不良の判別は、試験結果を人手により読取って行って いた。より具体的には、上述の例の場合、1本の試験用 前記試験用ピン毎に複数の前記良否判別データを記憶す 10 ピンに対して144個のデータが得られるので、この膨 大な試験結果の中からある試験ピンの試験結果の傾向を 読取り、試験結果が常に期待値よりも大きい場合等に は、当該試験用ピンが接触不良を起こしているという判 別を行っていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、非常 に小さな面積中に多数の試験用ピンを配置しているた め、往々にして接触不良が発生し易いという不具合があ った。また、この接触不良の判断は、試験結果を人手に より読み取って行っていたため、接触不良の判断基準が 統一化されておらず、場合によっては接触不良を見過ご してしまうという問題点があった。さらに、プリント基 板ユニットが正常であっても、プローブの接触不良が原 因で試験結果が不良と判断されてしまうという不具合が ・生じ、当該不良と判断されたプリント基板について異常 がないにもかかわらず、再度試験を行わなければなら ず、試験工程に時間がかかるという問題点があった。

【0005】そこで、本発明の目的は、接触不良の判断 基準の統一を図り、試験装置とプリント基板ユニットと の接触不良を早期に検出し試験工程の迅速化並びに試験 品質の向上を図ることが可能なプローブ接触状態判別装 置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明は、複数の試験用ピンを有するプローブの被 試験対象物に対する接触状態を判別するプローブ接触状 態判別装置において、前記被試験対象物の試験時の測定 データを記憶する記憶手段と、前記記憶された測定デー タを読出して、前記被試験対象物の試験結果の良否を判 別し、前記試験用ピンに対応付けて良否判別データを出 力する不良判別手段と、前記試験用ピン毎に複数の前記 良否判別データを記憶する良否判別データ記憶手段と、 前記記憶された複数の良否判別データに基づいて、当該 試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別する 接触不良判別手段と、を備えて構成する。

[0007]

【作用】本発明によれば、記憶手段は、前記被試験対象 物の試験時の測定データを記憶する。不良判別手段は、 前記記憶された測定データを読出して、前記被試験対象 けて良否判別データを良否判別データ記憶手段に出力する。良否判別記憶手段は、前記試験用ピン毎に複数の前記良否判別データを記憶する。接触不良判別手段は、前記記憶された複数の良否判別データに基づいて、当該試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別する。 【0008】したがって、測定データに基づいて、試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを自動的に判別することができる。

[0009]

【実施例】次に、本発明の実施例を図1乃至図4を参照 10 して説明する。図1にプリント基板ユニット試験装置の 基本構成ブロック図を示す。

【0010】プリント基板ユニット試験装置1は、試験における規格値などを記憶する図示しないメモリを有し、試験全体の制御を行う制御用コンピュータ2を有している。試験者はあらかじめコンソール3を介して制御用コンピュータ2に必要な各種試験用データを記憶させておく。

【0011】実際に試験を行う場合には、試験者はオペレータコンソールボックス4を操作することにより行う。オペレータコンソールボックス4から試験開始の命令(コマンド)が入力されると、当該コマンドはインターフェースコントロールユニット5を介して制御用コンピュータ2に伝達される。これにより制御用コンピュータ2は当該コマンドを解析し、必要な試験命令及び試験データをインターフェースコントロールユニット5を介して機構部制御用パソコン(パーソナルコンピュータ)6に出力する。機構部制御用パソコン6は、機構部7を制御して、図2に示す多ピンプローブ10を被試験プリント基板ユニット(UUT: Unit-board Under Test)8に接触させる。

【0012】接触した多ピンプローブ10により得られるデータは、スキャナ部11を介して選択的に測定部9に入力され、さらにインターフェースコントロールユニット5を介して制御用コンピュータ2の図示しないメモリに取り込まれる。制御用コンピュータ2において、図示しないメモリに取り込まれたデータは、様々な処理が行われ、試験結果及び多ピンプローブの接触状態の判別結果がプリンタ12に出力される。

【0013】ここで、試験用ピンの接触状態の判別処理 40 (プローブ接触精度評価)について図3及び図4を参照して説明する。この場合において、制御用コンピュータ 2の図示しないメモリには、あらかじめ、被試験プリント基板ユニットを特定するシリアル番号とともに当該被試験プリント基板ユニットの試験結果を格納するMD

(Measurement Data) バンク、プリント基板ユニット試験用の規格値、試験条件等が格納されたTP(Test Program) バンク及び試験用ピンの不良を検出した場合に記録するテーブルであるNG(No Go) マップの各領域を確保してあるものとする。

【0014】まず、プリント基板ユニット試験装置1は、複数のプリント基板ユニットの試験を行う(ステップS1)。これにより、制御用コンピュータ2のMDバンクには、当該試験対象であるプリント基板ユニットを特定するシリアル番号、試験結果が格納される。なお、試験結果は抵抗値で表されているものとする。

【0015】次に、制御用コンピュータ2のMDバンクの測定データを編集し、プローブ接触精度評価を行う (ステップS2)。まず、試験者は、コンソール3から プローブ接触精度評価を行うべきプリント基板ユニット を特定するためのシリアル番号を入力する (ステップS10).

【0016】制御用コンピュータ2は、MDバンクをサーチして(ステップS11)、入力されたシリアル番号に対応するプリント基板ユニットの測定データの有無を判別する(ステップS12)。

【0017】入力されたシリアル番号に対応するプリント基板ユニットの測定データが存在しない場合には、測定データが存在しないことをコンソール3の図示しないCRT (Cathode Ray Tube) に表示して(ステップS21)、処理を終了する。

【0018】入力されたシリアル番号に対応するプリント基板ユニットの測定データが存在する場合には、TPバンクをサーチして(ステップS13)、該当するTPが存在するか否かを判別する(ステップS14)。

【0019】次に、制御用コンピュータ2は、TPバンクの規格値などのデータとMDバンクの試験結果に基づいて、各試験用ピン毎に試験結果が規格値以上のデータを出力しNGマップを作成する(ステップS3)。な

お、NGマップには初期値として、全記録位置が"O" になっているものとする。

【0020】すなわち、TPバンクの規格値とそれに対応するMDバンクの試験結果とを比較し、試験結果の抵抗値が規格値の抵抗値以上の場合には、試験不合格であると判別し、NGマップの当該試験用ピンに対応する記録位置のビットを"1"にする。より具体的には、被試験プリント基板ユニットのあるモジュールのある試験用ピンに対応するTPバンクに記録されている規格値が 300Ω (規格範囲 295Ω ~ 305Ω)とすると、試験結果が 305Ω よりも大きい抵抗値である場合には、試験不合格であると判別し、当該モジュールの当該試験用ピンに対応する記録位置を"1"にする。したがって、各試験用ピン毎にモジュール数分の試験結果判別データがNGマップに記録されることとなる。

【0021】続いて、制御用コンピュータ2は、NGマップをサーチし(ステップS15)、接触不良の試験用ピンが存在するか否かを判別する(ステップS16)。すなわち、試験用ピン番号1から各試験用ピン毎にNGマップをチェックし、試験不合格データ(= "1")が 50 多くあらわれている試験用ピンを抽出する(ステップS

5

4)。例えば、当該試験用ピンの測定箇所のうち6割以上試験不合格データが現れている場合には、当該試験用ピンは接触不良が起こっている可能性が高いと判断し(ステップS5)、当該試験用ピン番号を特定し、出力情報を作成する(ステップS17)。

【0022】当該チェックしている試験用ピンのNGマップにおいて、接触不良が存在しない場合(ステップS6)には、プローブ上の全ピンのサーチが終了したか否かを判別し(ステップS18)、終了していない場合にはステップS15~ステップS18の処理を繰り返す。【0023】プローブ上の全ピンについてのNGマップのサーチが終了した場合には、接触不良が起こっている可能性が高い試験用ピン(累積NGピン)が存在するか否かを判別する(ステップS19)。累積NGピンが存在しない場合には、その旨をコンソールの図示しないCRTに表示し(ステップS21)、処理を終了する。

【0024】累積NGピンが存在する場合には、ステップS17で作成した出力情報をCRTとプリンタの双方または一方に出力し(ステップS20)、処理が終了したことをコンソールの図示しないCRTに表示して(ス 20 テップS21)、プローブ接触精度評価処理を終了する。この場合において、出力される出力情報としては、当該試験したプリント基板ユニットのシリアル番号、図番、試験実施年月日、再試験実施年月日、測定ピン数、接触不良ピン数、再試験の回数等が挙げられる。

【0025】以上のプローブ接触度評価処理が終了したならば、接触不良を起こしている可能性が高いと判断された試験用ピンを調査し、調査結果に基づいて試験用ピンの交換などの必要な処理を行う。

【0026】以上の説明のように、本実施例によれば、 試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを容易に判 別することができ、接触不良を早期に発見することがで きるとともに、接触不良を発見できないことによる不必 要な再試験などを行わなくてすみ、試験手順を迅速化す ることができる。

【0027】以上の実施例においては、接触不良を判別するための基準データとして抵抗値を用いていたが、電流値、電圧値等他のデータを基準として用いることも可

能である。

[0028]

【発明の効果】本発明によれば、不良判別手段により記憶された測定データを読出して、前記被試験対象物の試験結果の良否を判別して、前記試験用ピンに対応付けて良否判別データを出力し、接触不良判別手段により、記憶された複数の良否判別データに基づいて、当該試験用ピンが接触不良を起こしているか否かを判別する。

6

【0029】したがって、測定データに基づいて、試験 10 用ピンが接触不良を起こしているか否かを自動的に判別 することができるので、試験に要する労力を軽減し、接 触不良の判断基準の統一が図れ、試験装置とプリント基 板ユニットとの接触不良を早期に検出し試験工程の迅速 化並びに試験品質の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】プリント基板ユニット試験装置の基本構成を示すブロック図である。

【図2】多ピンプローブ周辺の装置の外観を示す斜視図である。

20 【図3】プローブ接触精度評価フローチャート(その1)である。

【図4】プローブ接触精度評価フローチャート(その 2)である。

【図5】多ピンプローブのピン配置例を示す平面図である。

【符号の説明】

1…プリント基板ユニット試験装置

2…制御用コンピュータ

3…コンソール

30 4…オペレーターコンソールボックス

5…インターフェースコントロールユニット

6…機構部制御用パソコン

7…機構部

8…被試験プリント基板ユニット

9…測定部

10…多ピンプローブ

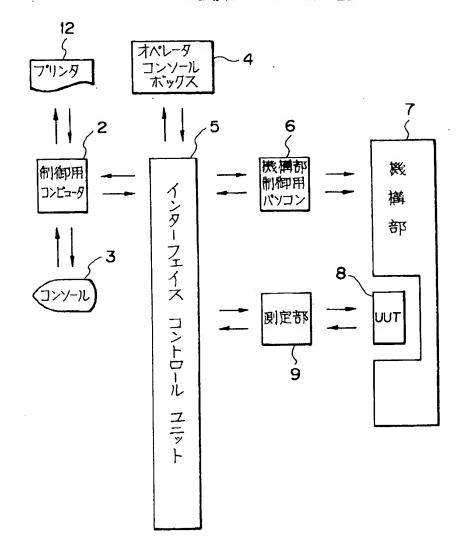
11…スキャナ部

12…プリンタ

【図1】

プリント基板ユニット試験装置の基本構成プロック図

1:プリント基板ユニット試験装置

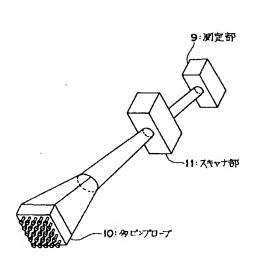


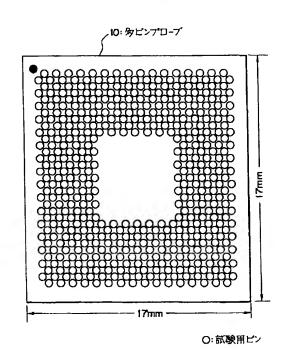
【図2】

タピンプローブ 周辺 装置の外観を示す**針**模図

【図5】

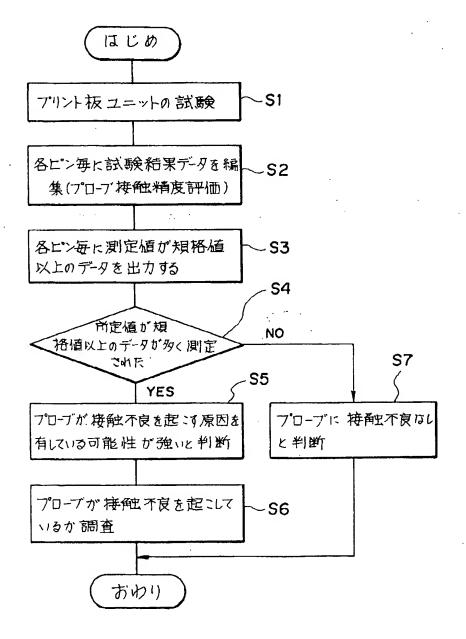
タピンプロ−ブのピン 配置例 を示す平面図



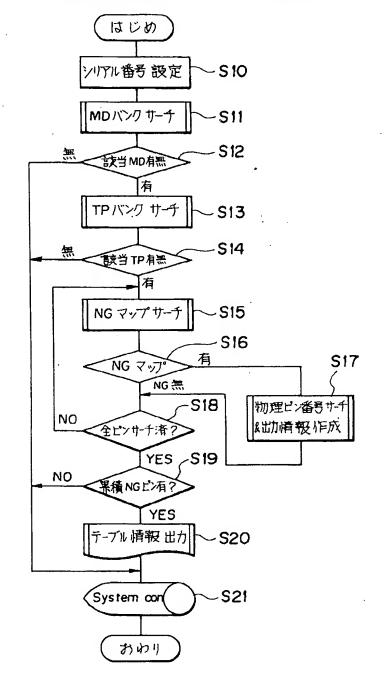


1/16/2007, EAST Version: 2.1.0.14

プローブ接触度評価フローチャート (その1)



「図4」 プローブ 接触度評価 フローチャート (その2)



フロントページの続き

(72)発明者 伊▲ざ▼ 智郁子 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内